

JAPANESE PATENT APPLICATION, FIRST PUBLICATION No. 2001-240972

INT. CL.7: C23C 16/458
C30B 25/12
H01L 21/31

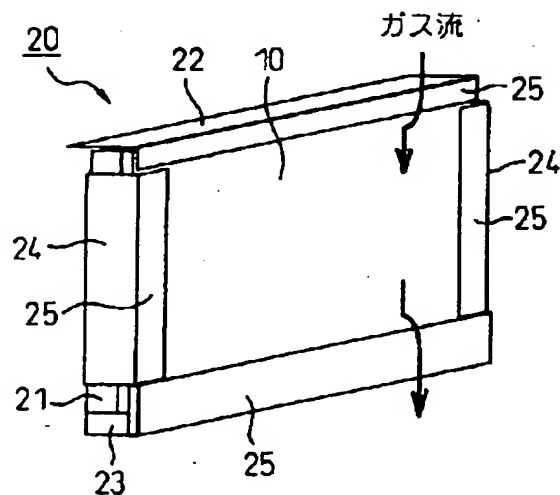
PUBLICATION DATE: September 4, 2001

TITLE Glass Substrate Housing Jig for CVD, ALE Apparatus
APPLICATION NO. 2000-058004
FILING DATE February 29, 2000
APPLICANT(S) DENSO CORP.
INVENTOR(S) Kazushige SUEMATSU, Kazuhiko SUGIURA, Nobuhiko OKADA & Yasuyuki TANAKA

ABSTRACT

PROBLEM - To offer a glass substrate housing jig for CVD and ALE apparatus preventing film forming gas from reaching the rear surface of the glass substrate and preventing breakage or cracking of the glass substrate.

SOLUTION - The glass substrate housing jig 20 for CVD, ALE apparatus of the present invention comprises a rear surface supporting portion 21 for supporting the rear surface of a glass substrate 10, and a top portion cover portion 22, a bottom portion supporting portion 23 and left-right side surface supporting portions 24 for holding the four side surfaces of the glass substrate, of which at least the bottom portion supporting portion positioned downstream of the gas flow has a retaining wall 25 covering the bottom edge surface. The end portions 26 of the retaining wall which do not contact the glass substrate are formed in a streamlined shape. The spacing between the rear surface supporting portion and retaining wall is variable.



公開特許公報フロントページ

(11)公開番号： 特開2001-240972

(43)公開日： 2001年09月04日

(51)Int.Cl7

C23C 16/458

C30B 25/12

H01L 21/31

(21)出願番号： 特願2000-058004

(71)出願人： 株式会社デンソー

(22)出願日： 2000年02月29日

(72)発明者： 末松 和重

杉浦 和彦

岡田 伸彦

田中 保之

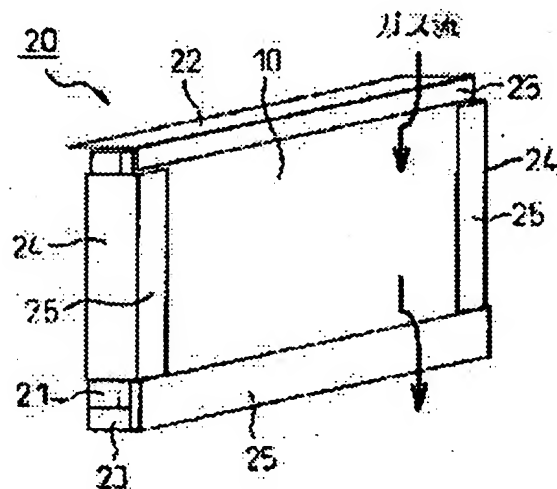
(54) CVD, ALE装置用ガラス基板収納治具

(57)【要約】

図 1

【課題】成膜ガスのガラス基板裏面への回り込みと、ガラス基板の割れ・欠けを防止したCVD, ALE装置用ガラス基板収納治具を提供する。

【解決手段】本発明のCVD, ALE装置用ガラス基板収納治具20は、ガラス基板10の裏面を支持する裏面支持部21と、ガラス基板の4つの側面を支える上部カバー部22、下部支持部23及び左右側面支持部24とより構成され、そのうち少なくともガス流の下流に位置する下部支持部が下辺表面を覆う押え壁25を有している。押え壁のガラス基板に接しない方の端部26は、流線形に形成される。ガラス基板を挟持する裏面支持部と押え壁との間隔は、可変となっている。



リーガルステータス

【審査請求日】

【拒絶査定発送日】

【最終処分種別】

【最終処分日】

【特許番号】

【登録日】

【拒絶査定不服審判番号】

【拒絶査定不服審判請求日】

【本権利消滅日】